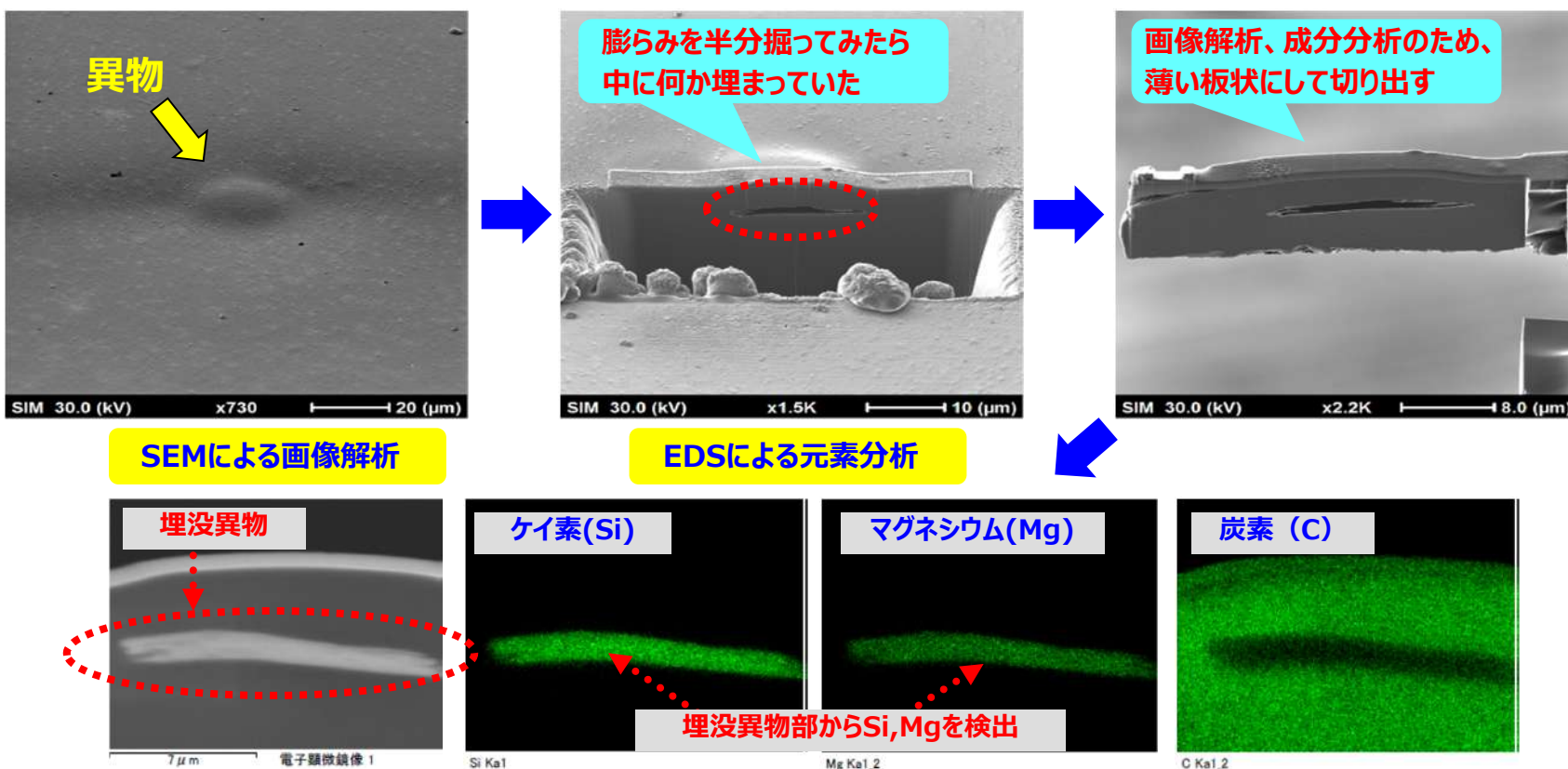


FIBによる局所断面化・観察

FIB（集束イオンビーム）は細く集束したGaイオンビームを試料表面に照射し走査することで試料表面の加工を行います。FIBは狙いたい所の微細加工が可能で、数ミクロン程の微小な領域でも狙って断面化できます。

7 μm ×2 μm の異物を断面化してSEM（電子顕微鏡）による画像解析、EDSによる元素分析を行いました。



巴川分析センターは分析力でモノづくりを支援します。いつでもお気軽にお問い合わせください。

TEL:054-256-4163 FAX:054-256-4214 <https://bunseki.tomoegawa.co.jp> E-mail:bunseki@tomoegawa.co.jp